OHBA, ToShio etal, Feb. 20, 2002 BSKA, LLP 許庁 (703) 205-8000 OFFICE 0171-0822 20千)

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

PATENT

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出願年月日 Date of Application: 日

JAPAN

2001年 6月22日

出 願 番 号 Application Number:

特願2001-189609

出 顏 人
Applicant(s):

信越化学工業株式会社

2001年12月21日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office



特2001-189609

【書類名】 特許願

【整理番号】 13322

【提出日】 平成13年 6月22日

【あて先】 特許庁長官 及川 耕造 殿

【国際特許分類】 C03B 37/01

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工

業株式会社 精密機能材料研究所内

【氏名】 川田 敦雄

【発明者】

【住所又は居所】 新潟県中頸城郡頸城村大字西福島28-1 信越化学工

業株式会社 精密機能材料研究所内

【氏名】 大庭 敏夫

【特許出願人】

【識別番号】 000002060

【氏名又は名称】 信越化学工業株式会社

【代理人】

【識別番号】 100079304

【弁理士】

【氏名又は名称】 小島 隆司

【選任した代理人】

【識別番号】 100103595

【弁理士】

【氏名又は名称】 西川 裕子

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 003207

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

特2001-189609

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光ファイバの製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ファイバ裸線又は一次もしくは二次被覆を施した光ファイバ心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、概ね大気圧下で電子線を照射し硬化させるにあたり、光ファイバ通過部に電場と磁場とを併設して電子線をこの電場と磁場内を通過させて光ファイバ上に二次元的に収束させることを特徴とする光ファイバの製造方法。

【請求項2】 磁場の方向が光ファイバの進行方向に平行、かつ電場の方向が光ファイバの進行方向と垂直であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバの製造方法。

【請求項3】 ファイバ通過部が不活性ガス雰囲気であることを特徴とする 請求項1又は2記載の光ファイバの製造方法。

【請求項4】 不活性ガスがヘリウムであることを特徴とする請求項3記載の光ファイバの製造方法。

【請求項5】 電子線が電圧60~160kVで加速された電子であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の光ファイバの製造方法。

【請求項6】 電子線硬化性樹脂の液状組成物が、ポリエーテルウレタンアクリレートオリゴマーと反応性希釈剤とを含有するものであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項記載の光ファイバの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光ファイバ心線に塗布された電子線硬化性樹脂の液状組成物を照射効率の高い電子線を用いて硬化する光ファイバの製造方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

電子線は物質中を進む際に、物質中の軌道電子を励起し、化学反応を起こしたり、二次電子やX線を発生させたりすることにより、徐々にエネルギを物質に分

け与え、失速するとともに、散乱を受け、進行方向がばらばらになり、拡散する 。この傾向は、特に固体のような密度の高い物質中では顕著である。このような 性質をもつ電子線は、印刷インク、塗料、粘着物質を剥離する剥離剤などの硬化 に既に使用されている。一方、その電子線を照射する装置については、何らかの 電子発生手段と電子加速手段を有しているが、従来の樹脂の硬化に使用されるも のは、一般的に、生産性を上げるために広い面積を照射するように設計され、比 較的低加速電圧の装置では幅広い電子線の帯を作り出す電子発生手段・電子加速 手段からなるいわゆるカーテン方式が、比較的高加速電圧の装置では細い線状の ビームを作り出す電子発生手段・電子加速手段とそのビームを幅広く振り分ける 電子走査手段からなるいわゆる走査方式が採用されていた。また、電子の発生と 加速は真空中で行うが、照射は生産性を考えて連続処理が容易な大気圧雰囲気中 で行なわれていた。大気圧と真空の境界は薄い金属箔からなるウインドウで仕切 り、電子線はそのウインドウを透過させて真空から大気圧に取り出すのが一般的 である。電子線はウインドウを透過する時に著しく散乱されるため透過後は拡散 してしまうが、そもそも広い面積に照射するものであるために問題はなかったが 、光ファイバのように非常に細いものに照射する場合、その照射効率は著しく低 いものであった。

[0003]

また、電子線を真空下で照射する場合は、電場又は磁場で電子線を収束する技術が既に実用化されており、電子線溶接機などに使用されているが、光ファイバに真空中で電子線を連続的に照射した場合、真空度の均一性を維持することが困難であると同時に、樹脂が発泡、飛散するという問題があった。

[0004]

また、特公平5-50454号公報に、光ファイバ被覆材の電子線硬化について記載されているものの、電子線の照射効率については言及されておらず、大気圧下、照射効率の高い電子線を光ファイバに連続して照射する技術は未だ確立されていない。

[0005]

光ファイバには、石英ガラス系、多成分ガラス系、プラスチック系等の種々の

ものがあるが、実際には石英ガラス系光ファイバが、軽量、低損失、高耐久、大 伝送容量という特長から広範囲の分野で大量に使用されている。しかしこの石英 ガラス系光ファイバは、最も一般的なもので直径が125μmと極めて細いので 、わずかな傷がついても切れやすく、また曲げなどの外的応力により伝送損失が 増大することから、柔らかい一次被覆層とそれを囲む硬い二次被覆層の二層から なる樹脂被覆が施される。通常は光ファイバが溶融線引きされた直後に裸光ファ イバ上に液状樹脂をダイコート法などで塗工後、熱や放射線(一般的には紫外線) 照射により硬化し、被覆が施される。二次被覆は一次被覆の塗工・硬化後に塗 工・硬化する場合と、一次被覆と同時に塗工・硬化する場合がある。更に被覆さ れた光ファイバは識別用にインクで着色されるのが一般的である。被覆された光 ファイバを数本(通常は4本又は8本)束ねて、液状樹脂を塗工後、熱や紫外線 等の放射線照射により硬化することにより、光ファイバテープが製造されている

[0006]

0

これらの被覆材としては、ウレタンアクリレート系の紫外線硬化性樹脂組成物が提案されており、特公平1-19694号、特許第2522663号、第2547021号公報に記載されているように、ウレタンアクリレートオリゴマーと、反応性希釈剤、光重合開始剤を主成分とする紫外線硬化性樹脂の液状組成物が知られている。

[0007]

近年光ファイバの生産において、生産性向上のため光ファイバの線引き速度が 高速化しており、樹脂被覆材を硬化させるのに必要な単位時間あたりのエネルギ も増大している。しかし、一般的に行われている紫外線硬化では、紫外線ランプ の出力の増加がその進歩に追いつかないのが現状である。従って紫外線照射装置 を何台も直列に設置する必要があり、設置可能な空間の大きさによって生産速度 が頭打ちになってしまう問題があった。

[0008]

一方、電子線硬化は、紫外線硬化に比べ、一般的にエネルギ効率が高いといわれるが、それはコート紙や印刷インキなどの樹脂硬化のように被照射物が幅広く

、電子線が拡散しても被照射物のどこかに当たる場合に限られる。光ファイバに 電子線を照射するために従来のカーテン方式の電子線照射装置を使用すると、た とえ電子線の帯の方向を細線の方向に合わせても、金属箔透過時の電子線の散乱 が著しいため、細線に命中する電子の割合が極めて小さく、エネルギ効率が低い という問題があった。また、走査方式の電子線照射装置を使用しても、たとえ走 査せずに細線上に静止することができたとしても、同様に金属箔透過時の電子線 の散乱が著しいため効率が低いという問題があった。このためポリエチレン被覆 電線の電子線架橋では、電線を折り返しながら走行させ、照射装置中を多数回通 過させることでこの問題を克服しているが、光ファイバのように液状組成物を塗 工したものを電子線硬化させる場合は、硬化が完全ではないうちに折り返すと被 覆が損なわれるのでこの方法は採用できないという問題があった。

[0009]

- E 41

また、光ファイバ被覆材の電子線硬化には、電子線が光ファイバのコアにドープされたゲルマニウムを変化させ、伝送損失の増大を招くという問題があった。

[0010]

本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、走行する光ファイバ心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、均一かつ効率よく連続的に電子線照射することにより、線引き速度の高速化に対応するとともに、照射効率を向上させることができ、しかも光ファイバの伝送特性を損なわない光ファイバの製造方法を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段及び発明の実施の形態】

本発明者らは、上記目的を達成するため鋭意検討を行った結果、真空の電子線発生部と大気圧照射部の仕切りである金属箔からなるウインドウを透過する時に散乱された電子線を光ファイバ心線に塗工された電子線硬化性樹脂の液状組成物に、大気圧下で照射し硬化させるにあたり、光ファイバ通過部に電場と磁場を併設することにより、照射効率が向上することを見出した。特に、光ファイバ通過部に、磁場の方向が光ファイバの進行方向に平行になるように磁場を設けるとともに、電場の方向が光ファイバの進行方向と垂直になるように電場を設けること

により、ウインドウを透過し散乱された電子を光ファイバ上に2次元的に収束することができることを見出し、本発明をなすに至った。

[0012]

Y .

従って、本発明は、下記の光ファイバの製造方法を提供する。

[請求項1] 光ファイバ裸線又は一次もしくは二次被覆を施した光ファイバ心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、概ね大気圧下で電子線を照射し硬化させるにあたり、光ファイバ通過部に電場と磁場とを併設して、電子線をこの電場と磁場内を通過させて光ファイバ上に二次元的に収束させることを特徴とする光ファイバの製造方法。

[請求項2] 磁場の方向が光ファイバの進行方向に平行、かつ電場の方向が光ファイバの進行方向と垂直であることを特徴とする請求項1記載の光ファイバの製造方法。

[請求項3] ファイバ通過部が不活性ガス雰囲気であることを特徴とする請求項1又は2記載の光ファイバの製造方法。

[請求項4] 不活性ガスがヘリウムであることを特徴とする請求項3記載の光ファイバの製造方法。

[請求項5] 電子線が電圧60~160kVで加速された電子であることを特徴とする請求項1~4のいずれか1項記載の光ファイバの製造方法。

[請求項6] 電子線硬化性樹脂の液状組成物が、ポリエーテルウレタンアクリレートオリゴマーと反応性希釈剤とを含有するものであることを特徴とする請求項1~5のいずれか1項記載の光ファイバの製造方法。

[0013]

以下、本発明につき更に詳しく説明する。

本発明に係る光ファイバの製造方法は、電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工した光ファイバ裸線又は一次もしくは二次被覆を施した光ファイバ心線を概ね大気圧下で電子線照射し、上記組成物を硬化させるものである。

[0014]

図1は、本発明に従って光ファイバを製造する装置の一例の概略を示す。

図中10は、両端面が閉塞された筒状の電子線照射部であり、その両端面には

、それぞれ光ファイバ心線1の入口部及び出口部となる開口部11、12が設けられ、光ファイバ心線1は一方の開口部(入口部)11から電子線照射部10内に入り、この電子線照射部10内中心を通り、この際電子線2が照射された後、他方の開口部(出口部)12から出るようになっている。なお、13は、電子線照射部内を不活性ガス雰囲気にする手段として、他方の端面に配された不活性ガス用配管で、この不活性ガス用配管13よりヘリウム、窒素等の不活性ガスが電子線照射部10内に供給され、電子線照射部10内における光ファイバ心線1の電子線照射を不活性ガス雰囲気で行うことができるようになっている。

[0015]

1 1

20は、密閉箱状の電子線発生部であり、内部に電子を発生する電子発生手段 21と、発生した電子を加速する電子加速手段22と、必要により図示していないが、加速された電子を収束する電子収束手段とがそれぞれ配設され、これによって電子線2が電子線照射部10に向けて照射されるようになっている。

[0016]

この電子線発生部20は、1台又は複数台配設される。複数台を配設する場合、複数台の電子線発生部20は、上記電子線照射部10を取り囲んで互いに概ね等間隔づつ離間して配設することが好適である。例えば、3台の電子線発生部20が電子線照射部10を中心として互いに120°離間した位置に配置することができる。

[0017]

ここで、電子線2が電子線照射部10内に透過する照射部側壁部分には、電子線2の進行方向に対向してウインドウ30が設けられ、電子線2は、このウインドウ30を通過して概ね大気圧下にある電子線照射部10内に侵入する。

[0018]

ここで、電子線発生部は電子発生手段、電子加速手段を具備し、場合によっては電子収束手段を備えていても良い。電子発生手段としては、熱電子放出、二次電子放出、電界電子放出、光電子放出などの現象を利用した従来公知の電子発生源、例えばタングステン、硼化ランタンなどの熱陰極やグロー放電冷陰極が使用できる。電子加速手段としては、直流電界又は高周波電界による従来公知の電子

加速手段、例えば平行平板電極間に直流高電圧をかけて作った直流電界や空洞共振器に高周波電圧をかけて作った高周波電界が使用できる。電子収束手段としては、電界レンズ、磁界レンズなど従来公知の電子収束手段、例えば3枚の電極板で作られた電界レンズや永久磁石又はソレノイドで作られた磁界レンズが使用できる。

[0019]

電子線発生部は光ファイバに向け電子が放出・加速できる構造であればよく、 棒状、板状、或いは円形状フィラメントや同一形状で孔の開いたグリッドなどが 使用できる。

[0020]

真空の電子線発生部と大気圧照射部の仕切りであるウインドウは、真空は保持するが、電子は透過するものでなくてはならない。強度があり、かつ、電子を透過させやすい原子番号が比較的小さい、Τi、Al、Si、Cなどの箔が一般に使用され、箔の厚みは上記要求を満足するよう、通常3~15μmに設定されている。

[0021]

本発明は、このような装置を用いて光ファイバ心線に電子線を照射する際に、電子線照射部10内に磁場発生手段40及び電場発生手段50の配設により磁場41及び電場51を形成し、これにより電子線を光ファイバ心線に収束させるものである。

[0022]

即ち、ウインドウを通過した電子は散乱するが、散乱した電子を電場と磁場で 収束することにより、光ファイバへの照射効率を向上することができる。この場 合、電場は例えば平行平板電極間に直流電圧をかけて作ることができ、磁場は永 久磁石又はソレノイド等の電磁石で作ることができる。

電場及び磁場の向きについては、照射効率が向上するかぎり限定されるものではなく、光ファイバに対し、垂直、水平、或いは斜めのいずれの方向でも可能であるが、特に、磁場の方向が光ファイバの進行方向に平行になるように磁場を設けるとともに電場の方向が光ファイバの進行方向と垂直になるように電場を設け

ることが、ウインドウを透過し散乱された電子を光ファイバ上に 2 次元的に収束 することができるので好ましい。

[0023]

即ち、図示したように、電子線の進行方向をX軸、このX軸と水平方向において直角方向をY軸、これらX、Y軸に対し、それぞれ垂直方向の光ファイバ進行方向をZ軸とした場合、磁場はZ軸方向、電場はY軸方向になるように設けることが好ましい。この際、ウインドウを光ファイバに対して磁場、電場それぞれに垂直になる方向に配置し、磁束密度と電場の強さを、下記式を満たすようにすることが必要である。

 $X = 2 n \pi m E / e B^2$

X:光ファイバとウインドウ間の距離, B:磁束密度, E:電場の強さ, m:電子の質量, e:電子の電荷, π:円周率, n:1以上の整数

[0024]

光ファイバとウインドウ間の距離は、小さ過ぎると接触の危険性があり、大きすぎると雰囲気ガスによるエネルギ散逸が大きくなるので、1~30mm、特には3~20mmとするのが好ましい。電場が弱すぎると、ドリフト速度が小さく、雰囲気ガスによるエネルギ散逸が大きくなるので、0.1kV/mm以上とするのが良い。一方、電場を強くすると放電の危険性が増すため、10kV/mm以下が望ましい。特には0.3~3kV/mmである。磁束密度は小さすぎると電子の回転半径が大きくなり、雰囲気ガスによるエネルギ散逸が大きくなるので、0.01T以上が望ましい。一方、磁場を強くするとそれに応じて電場も強くする必要があり、放電の危険性が増すため、1T以下が望ましい。特には0.03~0.3Tが好ましい。電場による持続放電を防ぐため、電場をパルス的にかけることができる。

[0025]

本発明は、光ファイバ心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、電子線 照射装置に供給し、上述したようにして電子線を照射し硬化させた後に、別途設 けられた光ファイバ巻き取り手段により巻き取る。この場合、電子線照射装置の 電子線照射部(光ファイバ通過部)は不活性ガス雰囲気で、圧力は概ね大気圧で あることが必要である。電子線照射部に酸素が存在すると電子を散乱しやすいばかりでなく、樹脂のラジカル重合を妨げ、樹脂の表面が硬化不良になる。不活性ガスとしては、例えば、原子番号の小さいHe、N2が望ましく、特にHeが電子の散乱が少ないため望ましい。また、連続照射において真空系は、その真空度を一定に維持することが困難であるばかりでなく、樹脂の発泡などの問題が生じやすくなり、加圧系は電子の散乱が大きくなるため、照射効率が低下するために、そのような問題が生じない圧力(概ね大気圧)下が好ましい。

[0026]

電子線の照射強度は、電子を発生させるフィラメントに流す電流を変えること によって調節でき、光ファイバの走行速度に連動して調節するのが望ましい。

[0027]

ここで、本発明の光ファイバの製造方法は、光ファイバ裸線に一次被覆材となる電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、これを硬化させる場合、光ファイバ裸線にそれぞれ電子線硬化性樹脂の液状組成物からなる一次被覆材、次いで二次被覆材を順次塗工し、これらを同時に硬化させる場合、一次被覆材の硬化皮膜が形成された光ファイバに二次被覆材となる電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、これを硬化させる場合、更には、一次被覆材及び二次被覆材の硬化皮膜が形成された複数本の光ファイバに電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、これを硬化させて光ファイバテープを得る場合(総じて、光ファイバ心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、これを硬化させるいずれの場合にも)、採用される。

[0028]

この場合、電子線硬化性樹脂の液状組成物としては、従来公知のもの、例えばポリエーテルウレタンアクリレートを主成分とするものが使用でき、粘度を調整する目的で反応性希釈剤が併用できる。ポリエーテルウレタンアクリレートはポリプロピレングリコール、ポリテトラメチレングリコールなどのポリエーテルに2,4ートルレンジイソシアネート、4,4'ージフェニルメタンジイソシアネートなどのジイソシアネートを反応させ、更にヒドロキシエチルアクリレートなどの水酸基を有するアクリレートを反応させることで得ることが出来る。硬化皮

膜の特性から望ましい数平均分子量は800~1000である。反応性希釈剤はエチレン性不飽和基を有する化合物が望ましく、ラウリルアクリレート、イソボロニルアクリレート、Nービニルカプロラクタム、エチレングリコールジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレートなどが例示される。

[0029]

なお、これら成分の配合量は適宜選定されるが、ポリエーテルウレタンアクリレート100重量部に対し、反応性希釈剤は20~200重量部であることが好ましい。

[0030]

光ファイバに電子線硬化性樹脂被覆材の液状組成物を塗工する方法としては従来公知の方法、例えばダイコート法が採用できる。電子線硬化性樹脂被覆材にポリエーテルウレタンアクリレートを主成分とするものを採用する場合、吸収線量が約10~約100kGyになるように照射するのが好ましい。吸収線量が約10kGyより小さいと樹脂が硬化不十分で、約100kGyより大きいと電子線による樹脂の劣化が起こる可能性がある。雰囲気中の酸素濃度は約1000ppm以下、より望ましくは10~300ppmにすることが望ましい。酸素濃度が約1000ppmより高いと表面が硬化不良になる。

[0031]

また、上記電子線は電圧60~160kVで加速された電子であることが好ましく、特に加速電子の最大エネルギが約120keV以下でかつ平均エネルギが約60keV以上である電子線を照射させるようにすることが好ましい。但し、上述したように、本発明の光ファイバの製造方法は光ファイバテープの製造も包含する。この場合には加速電子の最大エネルギが約160keV以下でかつ平均エネルギが約120keV以上の電子線を照射するのが好ましい。

なお、本発明の効果を更に向上するため、電子線発生部及び磁場、電場を複数 設けることも可能である。

[0032]

【実施例】

以下、実施例を挙げて、本発明を具体的に説明するが、本発明は下記実施例に

制限されるものではない。

[0033]

「実施例1]

真空中(10^{-4} Pa)で発生した熱電子を100k Vで加速し、得られた電子線を厚さ 10μ mのチタン箔ウインドウを透過させ、大気圧下、He雰囲気で、磁場の方向が光ファイバの進行方向に平行になるように磁束密度0.05Tの磁場をかけるとともに電場の方向が光ファイバの進行方向と垂直になるように1k V/mmの電場をパルス的にかけ、ウインドウから14.3mmの距離にある直径が 250μ mの光ファイバへ照射する計算シミュレーション(Heによる散乱は無視)を実施した。その結果を図 $2\sim10$ に示す。

[0034]

ここで、図2~10において、Eはウインドウ透過直後の電子の運動エネルギ 、θはウインドウ透過直後の電子の速度ベクトルがΧΥ平面となす角、φはウイ ンドウ透過直後の速度ベクトルがΧ軸となす角とした場合、

図2:E=80keV, θ =0°, ϕ =-30°, 最接近距離=0.000mm

図3:E=80keV, θ =0°, ϕ =0°, 最接近距離=0.000mm、

図4:E=80keV, θ =0°, ϕ =30°, 最接近距離=0.000mm、

図5:E=80keV, θ =15°, ϕ =-30°, 最接近距離=0.000mm、

図6:E=80keV, $\theta=15^{\circ}$, $\phi=0^{\circ}$, 最接近距離=0.000mm、

図7:E=80keV, $\theta=15^{\circ}$, $\phi=30^{\circ}$, 最接近距離=0.000mm

図8:E=40keV, θ =0°, ϕ =-30°, 最接近距離=0.000mm

図9:E=40keV, $\theta=0^{\circ}$, $\phi=0^{\circ}$, 最接近距離=0.000mm、

図10:E=40keV, $\theta=0^\circ$, $\phi=30^\circ$, 最接近距離=0.000mmであり、この結果よりウインドウで散乱された電子線は光ファイバ上に二次元的に収束することを確認した。

[0035]

【発明の効果】

本発明によれば、電子線の照射効率が高く、効率よく塗工された電子線硬化性樹脂の液状組成物を硬化して光ファイバを製造することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の実施に用いる光ファイバ製造装置の一例を示す概略図である。

【図2】

実施例 1 における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=80 k eV, $\theta=0$ °, $\phi=-30$ °の場合を示す。

【図3】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E = 80 k e V, $\theta = 0^\circ$, $\phi = 0^\circ$ の場合を示す。

【図4】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=80keV, $\theta=0^{\circ}$, $\phi=30^{\circ}$ の場合を示す。

【図5】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=80 k e V, $\theta=15$ °, $\phi=-30$ °の場合を示す。

【図6】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=80 k e V, $\theta=15^{\circ}$, $\phi=0^{\circ}$ の場合を示す。

【図7】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=80keV, $\theta=15^{\circ}$, $\phi=30^{\circ}$ の場合を示す。

【図8】

実施例 1 における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=40 k e V, $\theta=0$ °, $\phi=-30$ °の場合を示す。

【図9】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=40keV, $\theta=0^\circ$, $\phi=0^\circ$ の場合を示す。

【図10】

実施例1における電子線中心軌道の一例を示す説明図で、E=40keV, $\theta=0^\circ$, $\phi=30^\circ$ の場合を示す。

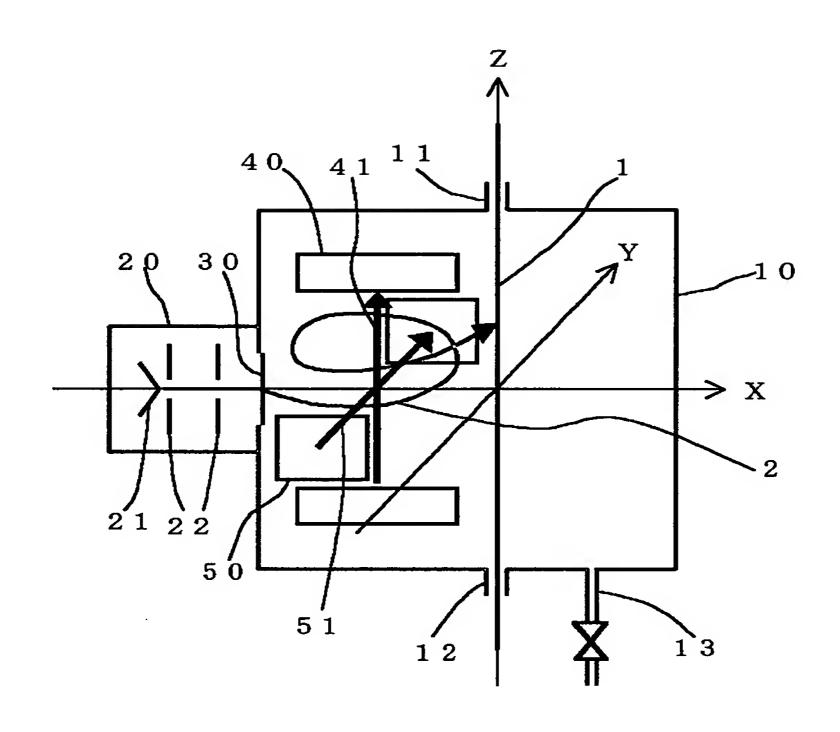
【符号の説明】

- 1 光ファイバ心線
- 2 電子線
- 10 電子線照射部
- 11、12 開口部
- 13 不活性ガス用配管
- 20 電子線発生部
- 21 電子発生手段
- 22 電子加速手段
- 30 ウインドウ
- 40 磁場発生手段
- 41 磁場
- 50 電場発生手段
- 51 電場

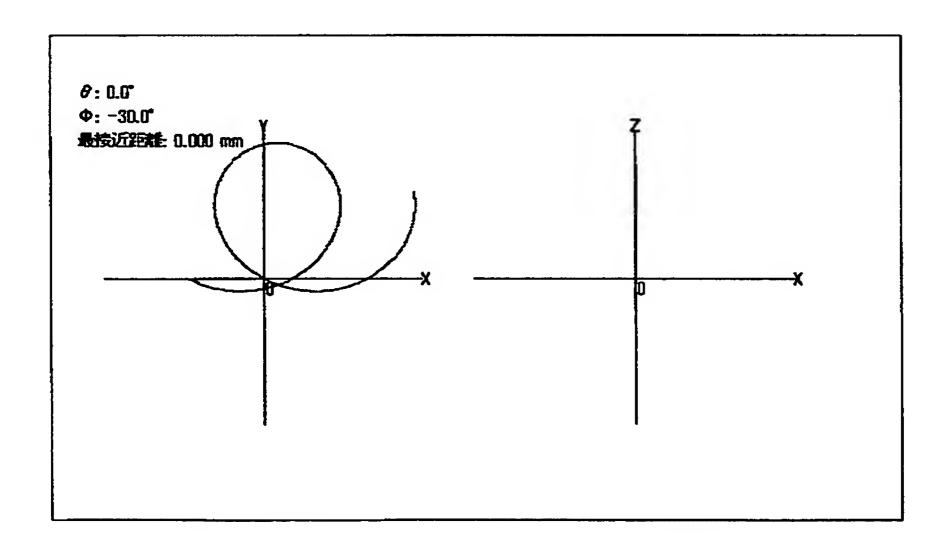
【書類名】

図面

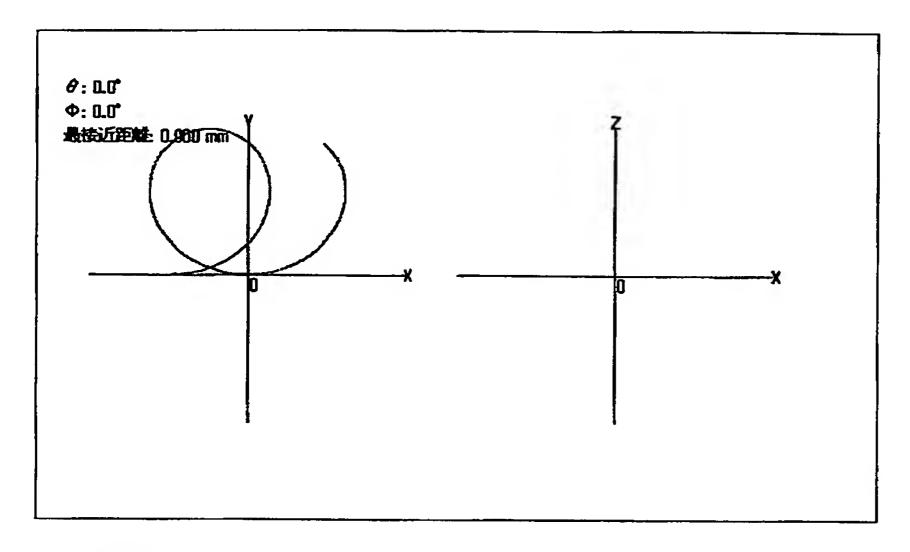
【図1】



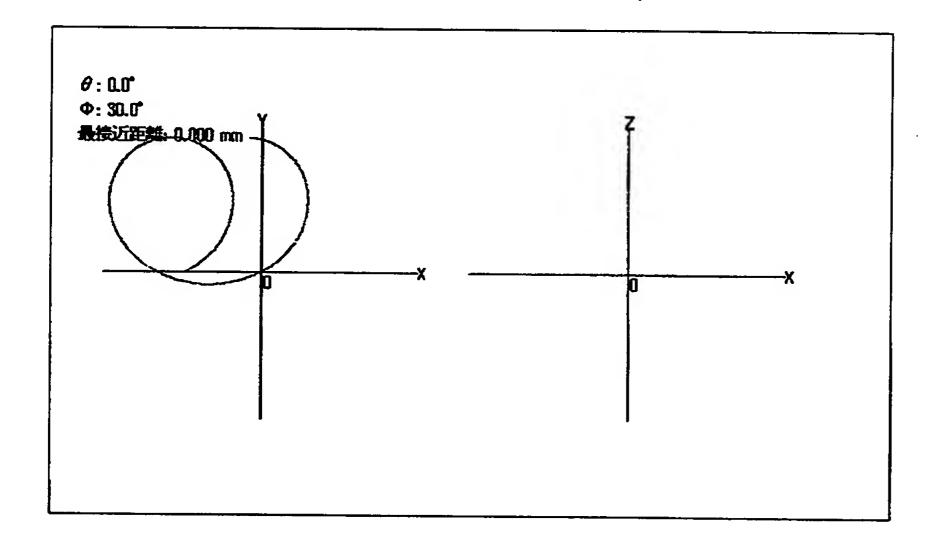
【図2】



【図3】

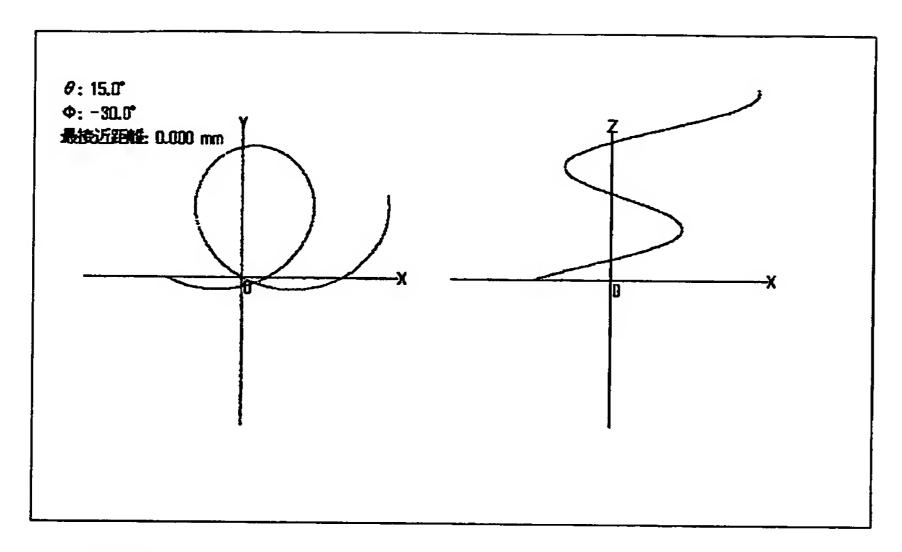


【図4】

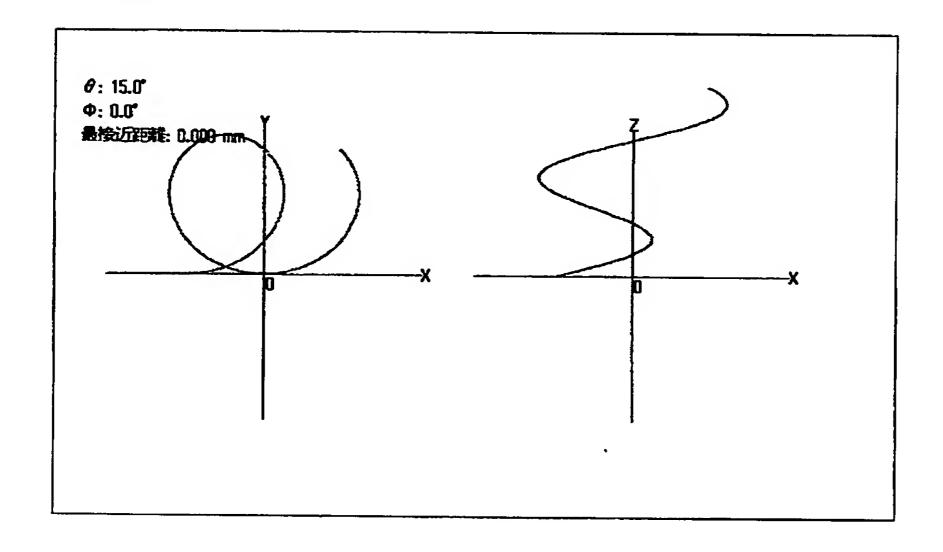


【図5】

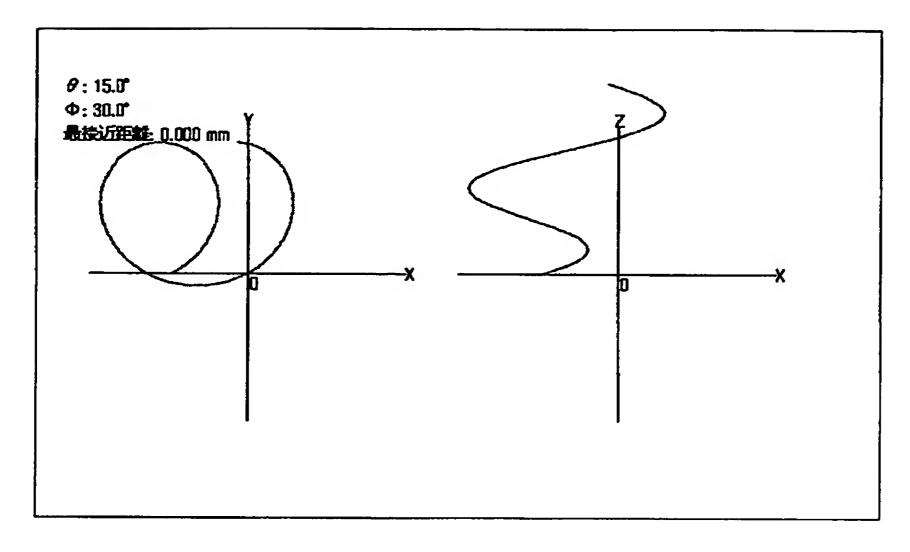
u 1 4 f



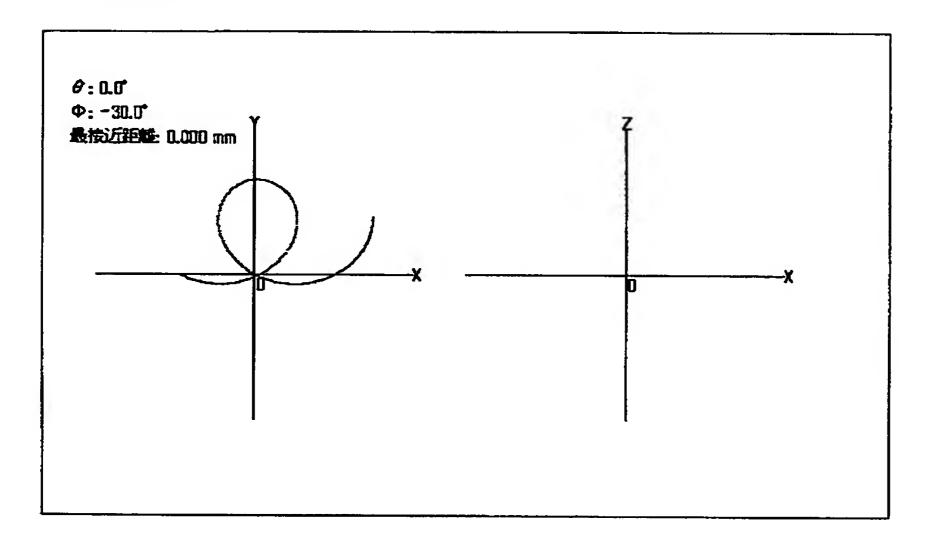
【図6】



【図7】

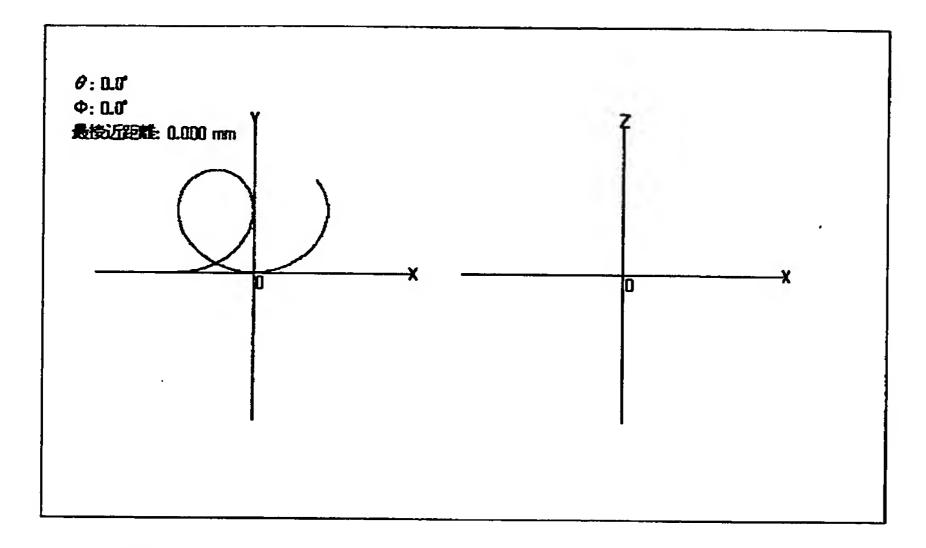


【図8】

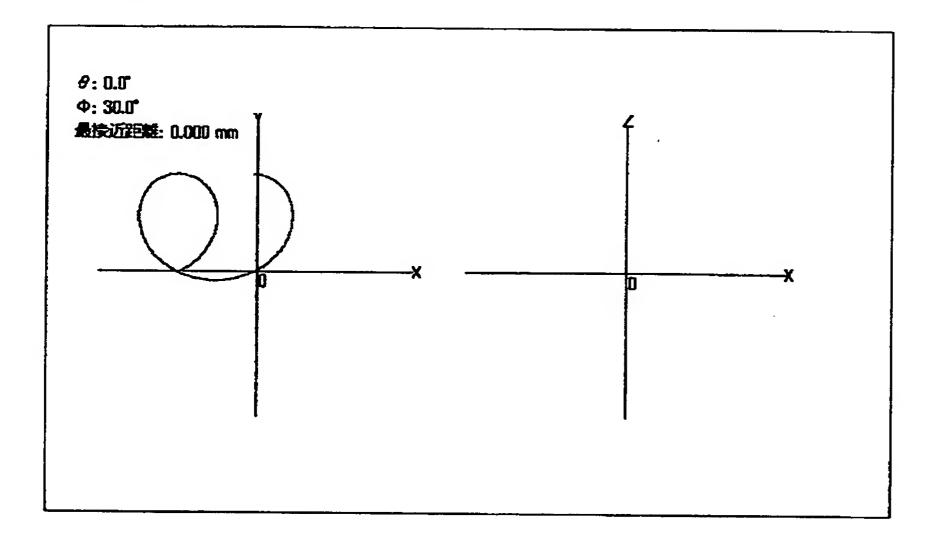


【図9】

 $-a\frac{3}{3} = -\frac{3}{4} \cdot \frac{4}{4} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac$



【図10】



【書類名】 要約書

【要約】

3 t 1 i

【解決手段】 光ファイバ裸線又は一次もしくは二次被覆を施した光ファイバ 心線に電子線硬化性樹脂の液状組成物を塗工し、概ね大気圧下で電子線を照射し 硬化させるにあたり、光ファイバ通過部に電場と磁場とを併設して電子線をこの 電場と磁場内を通過させて光ファイバ上に二次元的に収束させることを特徴とする光ファイバの製造方法。

【効果】 本発明によれば、電子線の照射効率が高く、効率よく塗工された電子線硬化性樹脂の液状組成物を硬化して光ファイバを製造することができる。

【選択図】 図1

出願人履歴情報

識別番号

 $(x_{-\lambda}^{(i)},\dots,x_{-k}) \in \mathfrak{t}_{-k}^{(i)}$

[000002060]

1. 変更年月日 1990年 8月22日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都千代田区大手町二丁目6番1号

氏 名 信越化学工業株式会社